

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-33963

(43)公開日 平成6年(1994)2月8日

(51)Int.Cl.⁶

F 16 F 1/32

B 28 B 11/02

C 04 B 38/00

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

8917-3J

9152-4G

301 A

審査請求 未請求 請求項の数2(全5頁)

(21)出願番号

特願平4-209628

(22)出願日

平成4年(1992)7月14日

(71)出願人 000000099

石川島播磨重工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 杉田 孝志

東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社技術研究所内

(72)発明者 大橋 英雄

東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社技術研究所内

(72)発明者 西 正輝

東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社技術研究所内

(74)代理人 弁理士 山田 恒光 (外1名)

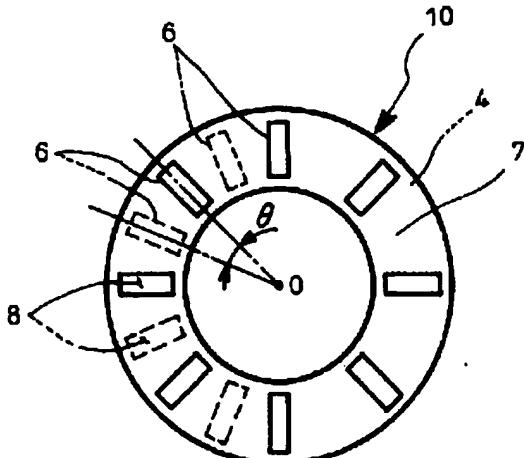
最終頁に続く

(54)【発明の名称】セラミック中空円盤積層ばねとその製造方法

(57)【要約】

【目的】高温環境下で使用できるセラミック中空円盤積層ばねとその製造方法を提供する。

【構成】セラミック粉末とバインダとを混練して形成したセラミック中空円盤4と、周方向等間隔位置に半径方向に延びるスリット6を有し且つ該スリット6に前記セラミック中空円盤4と同材質のセラミックリブ8を嵌め込んだプラスチック中空円盤7とを、前記セラミックリブ8の露出面に溶媒を塗布した上で前記セラミック中空円盤4を挟んで隣接するプラスチック中空円盤7相互のスリット6が周方向に互い違いにずれるよう複数層交互に積み重ねて積層体10を構成し、該積層体10を適度な加圧力で平坦に押さえながら乾燥させ、次いで、前記プラスチック中空円盤7及びバインダ類を加熱により気化分解し、然る後、前記セラミック中空円盤4及びセラミックリブ8を焼成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層された複数のセラミック中空円盤間に、該セラミック中空円盤の周方向に等間隔で配置され且つ積層方向にセラミック中空円盤を挟んで隣接する相互が互い違いとなるよう周方向に所要角度ずらして配置した複数のセラミッククリップを備えてなることを特徴とするセラミック中空円盤積層ばね。

【請求項2】 セラミック粉末とバインダとを混練して形成したセラミック中空円盤と、周方向等間隔位置に半径方向に延びるスリットを有し且つ該スリットに前記セラミック中空円盤と同材質のセラミッククリップを嵌め込んだ有機質中空円盤とを、前記セラミッククリップの露出面に溶剤を塗布した上で前記セラミック中空円盤を挟んで隣接する有機質中空円盤相互のスリットが周方向に互い違いにずれるよう複数層交互に積み重ねて積層体を構成し、該積層体を適度な加圧力で平坦に押さえながら乾燥させ、次いで、前記有機質中空円盤及びバインダ類を加熱により気化分解し、然る後、前記セラミック中空円盤及びセラミッククリップを焼成することを特徴とするセラミック中空円盤積層ばねの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、セラミック中空円盤積層ばねとその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、エンジニアリング部門におけるセラミック材料の利用が注目を集めしており、該セラミック材料の有する耐熱性、耐食性、耐摩耗性に優れるという性質からセラミック製ガスターピンやセラミック製ターボチャージャー等の開発が進められている。

【0003】 前記セラミック製ガスターピンやセラミック製ターボチャージャー等を実現する為には、苛酷な高温条件にさらされるセラミック構造体同士の間、或いはセラミック構造体と金属構造体との間に、熱膨張、熱衝撃等を緩和する為の応力緩衝部材を使用する必要がある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来からある金属製ばねでは、例えば1000°C以上の高温環境下で使用できるようなもののがなく、前記セラミック製ガスターピンやセラミック製自動車エンジン等を実現する上での障害となっていた。

【0005】 本発明は上述の実情に鑑みてなしたもので、高温環境下で使用できるセラミック中空円盤積層ばねとその製造方法を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明の請求項1に記載の発明は、積層された複数のセラミック中空円盤間に、該セラミック中空円盤の周方向に等間隔で配置され且つ積層方向にセラミック中空円盤を挟んで隣接する相互が

10

2

互い違いとなるよう周方向に所要角度ずらして配置した複数のセラミッククリップを備えてなることを特徴とするセラミック中空円盤積層ばね、に係るものであり、本発明の請求項2に記載の発明は、セラミック粉末とバインダとを混練して形成したセラミック中空円盤と、周方向等間隔位置に半径方向に延びるスリットを有し且つ該スリットに前記セラミック中空円盤と同材質のセラミッククリップを嵌め込んだ有機質中空円盤とを、前記セラミッククリップの露出面に溶剤を塗布した上で前記セラミック中空円盤を挟んで隣接する有機質中空円盤相互のスリットが周方向に互い違いにずれるよう複数層交互に積み重ねて積層体を構成し、該積層体を適度な加圧力で平坦に押さえながら乾燥させ、次いで、前記有機質中空円盤及びバインダ類を加熱により気化分解し、然る後、前記セラミック中空円盤及びセラミッククリップを焼成することを特徴とするセラミック中空円盤積層ばねの製造方法、に係るものである。

【0007】

【作用】 従って本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねによれば、セラミック中空円盤の周方向複数箇所が隣接する各層において互い違いに弾性変位可能であることから全体として積層方向に均等なばね定数を有するばねとして機能する。

【0008】 このセラミック中空円盤積層ばねは、全ての構成が耐熱性に優れたセラミック材料である為、高温環境下で使用することが可能で、各セラミック中空円盤の間に空隙を隔てた多層構造となっているので断熱効果が高く、しかも各セラミック中空円盤及び各セラミッククリップが薄肉構造となっているので熱応力も低い。

【0009】 又、本発明の請求項2に記載のセラミック中空円盤積層ばねの製造方法によれば、前記セラミック中空円盤積層ばねが極めて容易に製作され、しかも、後加工の不要な完成品として得られる。

【0010】

【実施例】 以下本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。

【0011】 図1～図6は本発明の一実施例を示すものである。

【0012】 図1に示す如く、セラミック粉末1とメチルセルロース等のバインダ2とを混練してシート状に押し出し成形したセラミックシート3を打抜き加工することによりセラミック中空円盤4を形成する。

【0013】 又、図2に示す如く、プラスチックシート5を打抜き加工することにより周方向等間隔位置に半径方向に延びるスリット6を有するプラスチック中空円盤7を形成し、前記スリット6には前記セラミック中空円盤4と同材質のセラミッククリップ8を嵌め込む。

【0014】 ここで、前記プラスチック中空円盤7の中心Oから前記スリット6の外側端までの寸法 r_1 と前記中心Oから前記スリット6の内側端までの寸法 r_2 は、

50

夫々前記セラミック中空円盤4の外径R₁と内径R₂と等しくなるようにしておく。

【0015】次いで、図3に示す如く、前記セラミックリブ8の露出面8aに水等の溶剤9を塗布した上で、図4に示す如く、前記セラミック中空円盤4とプラスチック中空円盤7とを複数層交互に積み重ねて積層体10を構成し、該積層体10を押さえ板11、11により適度な加圧力で平坦に押さえることによって、前記セラミックリブ8とセラミック中空円盤4とを接合して積層体10を一体化する。

【0016】この際、前記セラミック中空円盤4を挟んで隣接するプラスチック中空円盤7相互のスリット6が、図5に示す如く周方向に互い違いにθ角度ずれるよう配置して積層体10を構成する。例えば、図示の例では1枚のプラスチック中空円盤7に8個のスリット6を等間隔に形成しているので、隣接するプラスチック中空円盤7相互を22.5度ずつ角度をずらして積層する。

【0017】次いで、図4の状態のまま前記積層体10を押さえ板11、11により適度な加圧力で平坦に押さえながら加熱して乾燥させた後、図示しない大気雰囲気の加熱炉等に入れて800℃程度に加熱することによって、前記プラスチック中空円盤7と、セラミック中空円盤4及びセラミックリブ8に含まれるバインダ2類を気化分解して除去し、然る後、図示しない不活性雰囲気の別の加熱炉等に入れて前記より更に高温（セラミックがアルミナの場合は1500℃程度・空化珪素の場合には1800℃程度）で加熱し、前記セラミック中空円盤4及びセラミックリブ8を焼成すると、図6の周方向断面展開図に示されるように、焼成されて韌性を得たセラミック中空円盤4の周方向複数箇所が隣接する各層において互い違いに弾性変位可能となり、全体として積層方向に均等なばね定数を有するセラミック中空円盤積層ばね12が製作される。

【0018】以上の如くして製作されたセラミック中空円盤積層ばね12は、全ての構成が耐熱性に優れたセラミック材料である為、高温環境下で使用することが可能であり、苛酷な高温条件にさらされるセラミック構造体同士の間、或いはセラミック構造体と金属構造体との間に、熱膨張、熱衝撃等を緩和する為の応力緩衝部材として使用することができる。

【0019】更に、前記セラミック中空円盤積層ばね12は、各セラミック中空円盤4の間に空隙を隔てた多層構造となっているので、断熱効果が高く、例えば温度差のあるセラミック構造体と金属構造体との間に用いる場合等に有用性が高い。

【0020】又、前記セラミック中空円盤積層ばね12は、各セラミック中空円盤4及び各セラミックリブ8が薄肉構造となっているので熱応力が低く、耐久性が高い。

【0021】更に、前記セラミック中空円盤積層ばね12

2は、セラミック中空円盤4の積層枚数を変えることにより任意にばね剛性を設定することができるので、ばね剛性の設計が極めて容易である。

【0022】又、以上に述べた製造方法によれば、前記の如き種々の効果を有するセラミック中空円盤積層ばね12を極めて容易に製作することができるので量産性が高く、しかも、後加工の不要な完成品として得ることができるので製作コストが低い。

【0023】尚、本発明のセラミック中空円盤積層ばね12とその製造方法は、上述の実施例にのみ限定されるものではなく、セラミック中空円盤の積層数及びセラミックリブの設置数は図示の例に限定されないこと、有機質中空円盤の材質はプラスチック以外に加熱により容易に気化分解可能な有機質材料であれば良く、例えば紙等を用いても良いこと、セラミックリブ（スリット）の形状は長方形以外でも良いこと、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

【0024】

【発明の効果】上記した本発明のセラミック中空円盤積層ばねとその製造方法によれば、下記の如き種々の優れた効果を奏し得る。

【0025】（I）本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、全ての構成が耐熱性に優れたセラミック材料である為、高温環境下で使用することが可能であり、苛酷な高温条件にさらされるセラミック構造体同士の間、或いはセラミック構造体と金属構造体との間に、熱膨張、熱衝撃等を緩和する為の応力緩衝部材として使用することができる。

【0026】（II）本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、各セラミック中空円盤の間に空隙を隔てた多層構造となっているので、断熱効果が高く、例えば温度差のあるセラミック構造体と金属構造体との間に用いる場合等に有用性が高い。

【0027】（III）本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、各セラミック中空円盤及び各セラミックリブが薄肉構造となっているので熱応力が低く、耐久性が高い。

【0028】（IV）本発明の請求項1に記載のセラミック中空円盤積層ばねは、セラミック中空円盤の積層枚数を変えることにより任意にばね剛性を設定することができるので、ばね剛性の設計が極めて容易である。

【0029】（V）本発明の請求項2に記載の製造方法によれば、前記（I）～（IV）の如き種々の効果を有するセラミック中空円盤積層ばねを極めて容易に製作することができるので量産性が高く、しかも、後加工の不要な完成品として得ることができるので製作コストが低い。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるセラミック中空円盤

5

6

の平面図である。

【図2】本発明の一実施例におけるプラスチック中空円盤の平面図である。

【図3】図2のプラスチック中空円盤のスリットに嵌め込んだセラミックリップの拡大斜視図である。

【図4】本発明の一実施例における積層体の一部を切り欠いて示す側面図である。

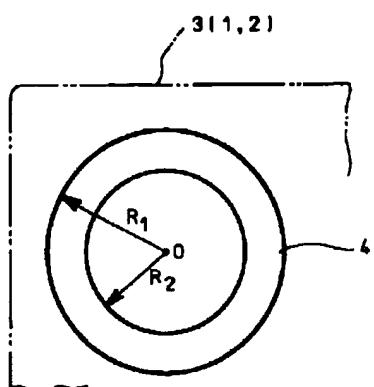
【図5】隣接するプラスチック中空円盤相互の積層状態を示す平面図である。

【図6】本発明の一実施例におけるセラミック中空円盤積層ばね積層ばねの周方向断面の展開図である。

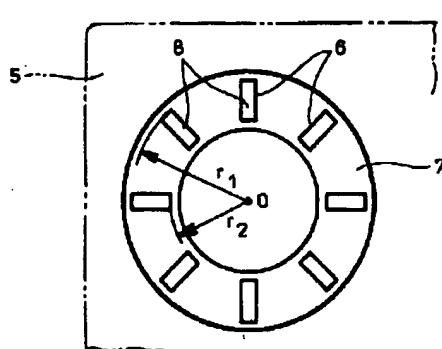
【符号の説明】

1	セラミック粉末
2	バインダ
4	セラミック中空円盤
6	スリット
7	プラスチック中空円盤
8	セラミックリップ
9	溶剤
10	積層体
12	セラミック中空円盤積層ばね

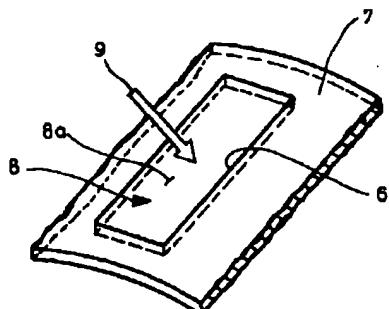
【図1】



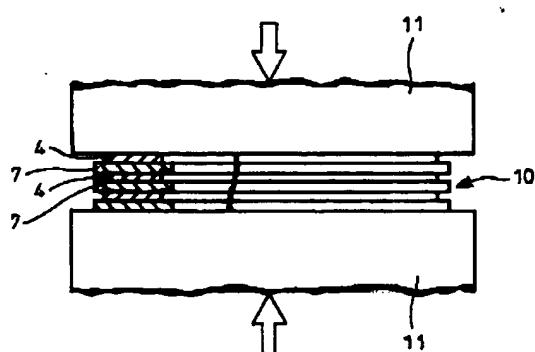
【図2】



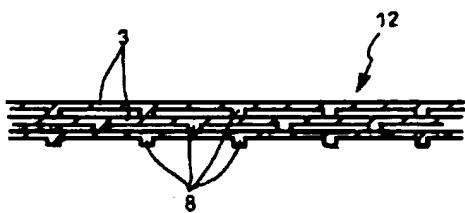
【図3】



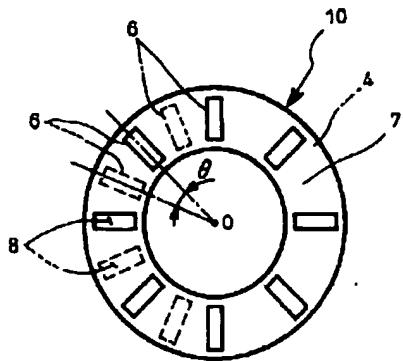
【図4】



【図6】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 宮原 薫
東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島
播磨重工業株式会社技術研究所内

